

主要特点

- 库伦型静电吸盘
- 支持双电极、多电极设计
- 适用于 10^{-5} Pa及以下超高真空环境
- 静电吸附力大, 24H残余吸附力>60%
- 吸附面全局面型精度高
- 吸附面表面图形可定制
- 适用于无磁环境

性能简介

静电吸盘(ESC)是半导体工艺中的硅片夹持工具。ESC以静电吸附为基本原理在施加外部高压后,通过静电吸盘对硅片的库仑吸附力或J-R吸附力来固定硅片的。

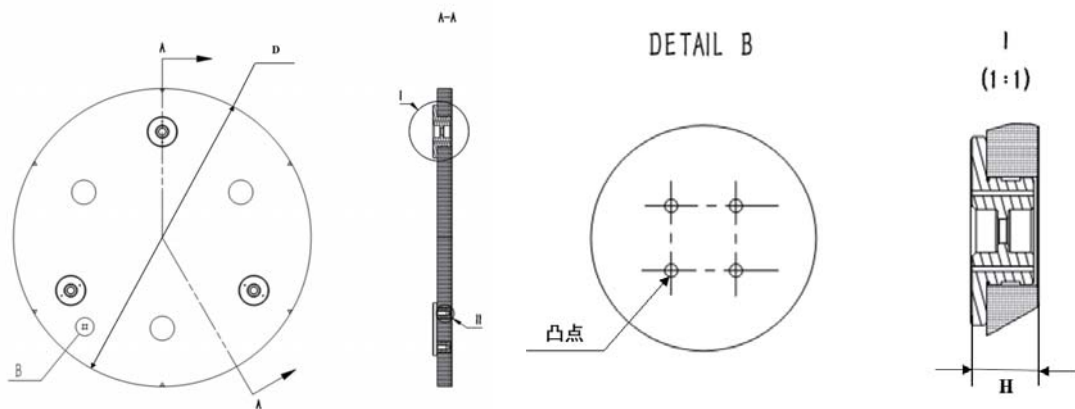
选择隐冠的原因

1. ESC和定制控制器由单一供应商提供,确保系统性能良好。
2. 最小化脱夹时间,提高ESC操作效果。
3. 在晶圆加工过程中保持均匀和恒定的夹紧力。

主要应用

- 电子束检测
- CD-SEM
- 键合
- Review-SEM

机械尺寸图



通用外形尺寸,单位:mm

技术参数

	单位	6inch ESC	8inch ESC	12inch ESC
原理类型/Electrostatic type		库伦型	库伦型	库伦型
电极数量/Number of electrodes		双电极	双电极	
精度/Accuracy				
全局平面度/Global flatness	μm	<1	<1	<2
平行度/Parallelism	μm	<5	<5	<5
电气性能/Electrical properties				
标准吸附电压/Standard clamping voltage	V	1000	1000	1000
漏电流/Leakage current	nA	<5	<5	<5
性能参数/Performance parameter				
吸附力/Clamping force	N	≥10	≥16	≥40
24h 残余吸附力 /Residual clamping force after 24H	N	≥6	≥12	≥24
外观尺寸/Dimensions				
直径/Diameter	mm	144	194	294
厚度/Thickness	mm	12.6	12.6	12.6

*电极数量、平面度指标、外形尺寸和相关结构均可定制化设计